МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2023/2024 навчальний рік, прийому студентів 2023 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"__"_____ 2023 р.

Спеціальність	174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка	Факультет/ННІ	Приладобудівний факультет
Освітня програма	Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні	Форма здобуття вищої освіти	*Заоч.*
Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 4 місяці
Випускова кафедра	*Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю*	Кваліфікація	магістр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор												1 курс							
																								ПМ-з31мп (Б: 5, К: 5);							
																								1 семестр				2 семестр			
																								18 тижнів				18 тижнів			
																									у т.ч.				у т.ч.		
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Всього	Лекц	Практ	Лаб	Всього	Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 1. Право інтелектуальної власності*	КІВПП	5	5	1.0	30	4	2	-	2	-	-	-	0	26												4	2	2	
2	*Інтелектуальна власність та патентознавство. Частина 2. Патентознавство та набуття права*	КМ	5	5	2.0	60	6	4	-	2	-	-	-	0	54		2					2						6	4	2	
3	*Основи інженерії та технології сталого розвитку*	ШІ	5	5	2.0	60	8	4	-	4	-	-	-	0	52		2					2						8	4	4	
4	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 1*	АМТС1	5	5	1.5	45	6	-	-	6	-	-	-	0	39							1	1	6		6					
5	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 2*	АМТС1	5	5	1.5	45	6	-	-	6	-	-	-	0	39		2											6		6	
6	*Розробка стартап-проектів*	ЕК	5	5	3.0	90	10	4	-	6	-	-	-	0	80		1					1		10	4	6					
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					11	330	40	14	0	26	0	0	0	0	290	0	4	0	0	0	0	4	1	16	4	12	0	24	10	14	0
Цикл професійної підготовки																															
7	*Сучасна теорія управління*	КІОНС	5	5	4.0	120	16	10	-	6	-	-	-	0	104	1						1		16	10	6					
8	*Математичне моделювання процесів та систем*	ВП	5	5	4.0	120	16	10	-	6	-	-	-	0	104	1						1		16	10	6					
9	*Робототехніка та інтелектуальні системи*	АСНК	5	5	5.0	150	16	10	-	6	-	-	-	0	134		1					1		16	10	6					
10	*Надійність і діагностика приладів і систем*	АСНК	5	5	5.0	150	12	6	-	6	-	-	-	0	138		1				1			12	6	6					
11	*Цифрова обробка сигналів та зображень*	АСНК	5	5	5.5	165	16	10	-	6	-	-	-	0	149	1		1			1			16	10	6					
12	*Основи наукових досліджень*	ВП	5	5	2.0	60	8	2	-	6	-	-	-	0	52		1					1		8	2	6					
13	*Комп'ютерний зір*	КІОНС	5	5	4.5	135	8	2	-	6	-	-	-	0	127		2					2						8	2	6	
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					30	900	92	50	0	42	0	0	0	0	808	3	4	1	0	0	2	5	0	84	48	36	0	8	2	6	0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					41	1230	132	64	0	68	0	0	0	0	1098	3	8	1	0	0	2	9	1	100	52	48	0	32	12	20	0
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
14	*Космічні оптико-електронні системи*	КІОНС	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
15	*Військові оптичні та оптико-електронні прилади*	КІОНС	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
16	*Новітні прилади систем орієнтації та навігації* ‡	КІОНС	0	0	4.0	120	20	10	-	-	-	10	-	0	100		2					2						20	10		10
17	*Випробування і контроль приладів і систем*	КІОНС	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
18	*Основи автоматизації технологічних процесів* ‡	АСНК	5	5	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
19	*Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системах* ‡	АСНК	5	5	4.0	120	20	10	-	-	-	10	-	0	100		2					2						20	10		10
20	*Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю*	АСНК	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
21	*Новітні системи та технології обробки сигналів*	АСНК	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
22	*Технології віртуального виробництва*	ВП	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
23	*Методи оптимізації процесів і систем*	ВП	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
24	*Кріогенна медична техніка*	ВП	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
25	*Біометрія*	ВП	0	0	4.0	120	20	10	-	10	-	-	-	0	100		2					2						20	10	10	
26	*Перетворення сигналів в оптико-електронних системах*	КІОНС	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
27	*Тепловізійні оптико-електронні прилади*	КІОНС	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
28	*Проєктування оптичних систем*	КІОНС	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
29	*Інтелектуальні прецизійні мехатронні комплекси вимірювання параметрів*	АСНК	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
30	*Основи інженерного експерименту*	АСНК	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
31	*Інтегровані технології систем автоматизації випробувань*	АСНК	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
32	*Комп'ютеризовані системи керування рухомими об'єктами*	КІОНС	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
33	*Автоматичні системи орієнтації і стабілізації* ‡	КІОНС	0	0	5.0	150	20	10	-	-	-	10	-	0	130	2						2						20	10		10
34	*Навігаційні системи*	КІОНС	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
35	*Сучасні оптичні технології та системи*	АСНК	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
36	*Мікроконтролери в системах неруйнівного контролю* ‡	АСНК	5	5	5.0	150	20	10	-	-	-	10	-	0	130	2						2						20	10		10
37	*Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю*	АСНК	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
38	*Автоматизована розробка керуючих програм*	ВП	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
39	*Моделювання параметрів автоматизованих систем*	ВП	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
40	*Діагностика засобів автоматизації технологічних процесів*	ВП	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
41	*Аналіз вимірювальних сигналів*	ВП	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
42	*Генезис біосигналів*	ВП	0	0	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
43	*Біофотоніка* ‡	ВП	0	0	5.0	150	20	10	-	-	-	10	-	0	130	2						2						20	10		10
44	*Інформаційно-вимірювальні технології в галузі енергозбереження*	АСНК	5	5	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
45	*Моделювання процесів і систем в енергозбереженні*	АСНК	5	5	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
46	*Інтегровані технології оцінки відповідності вимірювальних приладів і систем у енергозбереженні*	АСНК	5	5	5.0	150	20	10	-	10	-	-	-	0	130	2						2						20	10	10	
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					23	690	100	50	0	50	0	0	0	0	590	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	100	50	50	0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	100	50	0	50	0	0	0	0	590	3	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	100	50	50	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					64	1920	232	114	0	118	0	0	0	0	1688	6	10	1	0	0	2	14	1	100	52	48	0	132	62	70	0

‡ Виконано перерозподіл аудиторних годин

Кількість									
Кількість екзаменів	6	3				3			
Кількість заліків	10		4				6		
МКР	1			1					
Курсових робіт	0								
Курсових проєктів	0								
РГР, РР, ГР	2		2						
ДКР	14			6				8	
Рефератів	1				1				

Ухвалено на засіданні Вченої ради ПБФ ПРОТОКОЛ № _____ від _____

Завідувач кафедри АСНК _____ Юрій КИРИЧУК (підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Григорій ТИМЧИК (підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;